

MicroEtch系列

四轴联动激光刻蚀加工设备

Micro Etching Equipment(Four-Axis Linkage)

型号：MicroEtch 80LM

产品概述

设备采用高功率脉冲激光器作为加工光源，通过模型重构、机械轴+振镜轴五轴联动等功能可实现大尺寸回转体表面、三维微曲面及二维平面的表面精密刻蚀。该设备在三维表面高效高精度刻蚀方面极具优势。

产品功能

- 龙门式+转台机床结构，满足大尺寸回转体零件表面刻蚀，兼容三维微曲面及平面刻蚀需求；
- 具备机械轴+振镜轴的三维五轴联动功能，保证刻蚀连续无拼接，高精度、高效率；
- 实现三维零件模型实时重构加工，无需模型预处理仿真，适用于多种零件加工；
- 具备三维模型曲面插补及路径优化功能，能快速针对加工模型进行加工预处理；
- 具备专用刻蚀软件，三维回转模型图像定位及平面图像测量，硬件/流程状态监控及权限配置功能。
- ★ 机床行程及激光器配置可定制

产品指标

机床行程X/Y/Z（mm）	800/700/350
B轴（°）	n×360
定位精度X/Y/Z（mm）	0.005 / 0.005 / 0.01
B轴（arc sec）	15
快移速度（X/Y/Z轴）（mm/s）	300 / 300 / 100
转速（B轴）（rpm）	10
激光器平均功率（w）	20
零件最大重量（kg）	20
工作台最大荷重（kg）	30
设备重量（kg）	5000
设备占地尺寸（mm）（宽X深X高）	3700X4350X3000

